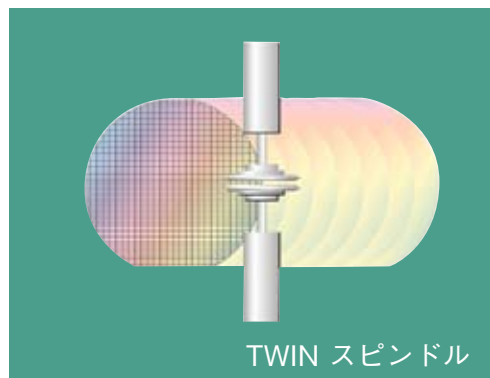




Wafer Dicing Machine

A-WD-300TX



株式会社東京精密

次世代高速ウェーハダイシングマシン

A-WD-300 TX

スピンドル回転数 80,000min⁻¹ を実現

スピンドル軸は、東京精密で長年培った加工技術の粋を集めた、新開発 80,000min⁻¹ 高速回転スピンドルを標準搭載。

今まで実現ができなかった、高速切断、高加工品質の新たな加工分野の世界を切り開きます。(特許申請中)



X 軸移動速度 毎秒 1,000mm を達成 業界初！

X 軸リニアモータの更なる高速化の追求により、移動速度 業界初の毎秒 1,000mm を達成。

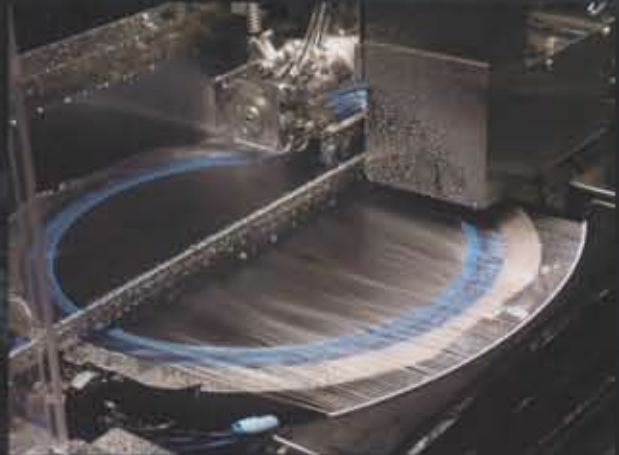
高速スループット化を実現しました。駆動部には、東京精密で長年培った定評あるエアガイド方式を採用、リニアモータとの組み合わせにより、完全非接触機構とすることで、振動を抑えた高加工品質を提供します。

3 連式エア加速洗浄ヘッドで洗浄時間を約 1/2 に短縮 業界初！



従来式に比べ、洗浄時間を約 1/2 に短縮することで、搬送部での待ち時間を大幅に削減しました。3 連式エア加速洗浄ヘッドによる高い洗浄効果は、切削後に付着するコンタミネーション除去にも威力を発揮します。(特許申請中)

流水洗浄ユニットでコンタミネーションを低減 業界初！



流水洗浄ユニットの標準搭載で、切削中に発生するコンタミネーションの付着を低減させます。(特許申請中)

17インチタッチパネルモニタ採用

直感的な操作が可能なタッチパネル方式を継承。
操作画面の大型化で、視認性、操作性が向上しました。

ソフトウェアのオートメーション化

自動化、簡単化を徹底的に追求した GUI(Graphical User Interface) オペレーションを提供します。
従来、オペレータが介在していた複雑な操作、設定を極力なくし、装置が自ら判断、オペレーションのアシストを積極的に行います。
操作時間の低減、エラーリカバリー機能の強化を実現しました。

1スピンドルに1セットの顕微鏡と光学式カッターセットユニット

高倍率顕微鏡、光学式カッターセットユニットを Z1、Z2 それぞれに配置することで、アライメント、カーブチェック、セットアップ時間の短縮と高速化を実現しました。
顕微鏡、光学式カッターセットユニットには、コンタミネーション付着防止のために、メカ式カバーを装備しました。

ブレード間ピッチ 25mm 標準採用

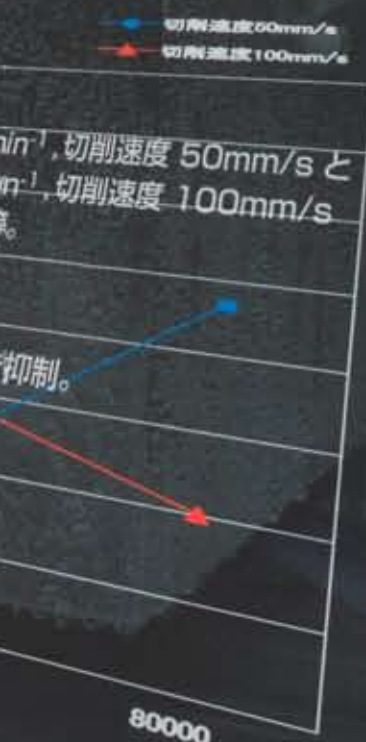
小チップ系デバイスなどの場合、ブレード間ピッチを縮めることで、高い生産性を確保できます。
ブレード間ピッチを従来の 34mm から 25mm とすることで、標準仕様で優れた生産性を発揮します。

優れたメンテナンス性

最適な装置レイアウトは前後からのアクセスを容易にさせ、メンテナンス性が大幅に向上しました。

USB インターフェース採用

バージョンアップや品種データの保存などに威力を発揮するインターフェースとして USB 方式を採用しました。

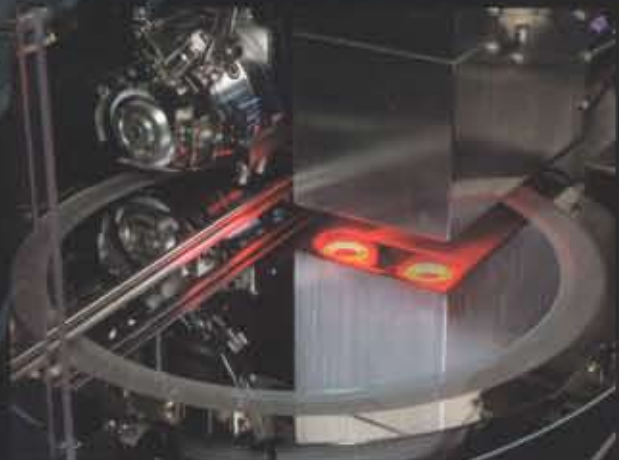


エアーが止まってもウェーハを落とさない 業界初!



搬送アームに搭載するウェーハ保護システムは、万一発生するエアーダウンの事故から、ウェーハ落下を未然に防ぎます。ウェーハ吸着部には、ステッピングモータ機構の加減速運転方式を採用。衝撃に弱い薄ウェーハや、小チップウェーハの脱着時に懸念されるストレスを大幅に低減、信頼性が高く、安定した搬送が可能となりました。(特許申請中)

赤色 LED 照明、新型顕微鏡の採用



モニター画面で見るウェーハのコントラスト、解像度が飛躍的に向上しました。

A-WD-300TX 仕様

最大ウェーハサイズ	Φ300mm	
フレームサイズ	8",12"	
スピンドル 1,2	定格出力	1.2kw
	最大回転数	80,000min ⁻¹
静的総合精度		0.004mm
X 軸	移動速度	0.1~1.000mm/s
Y1,2 軸	位置決め制度	0.002mm/310mm
	制御分解能	0.0001mm
	切削可能範囲	310mm
Z1,2 軸	位置決め制度	0.003mm/1mm
	移動分解能	0.0002mm
	繰り返し精度	0.0015m
	最大対応ブレード径	Φ60mm
θ 軸	制御分解能	0.3"
	回転範囲	720°
電源		三相AC200~220V 50/60Hz ※オプショントランスにてマルチ電源に対応
エアー	供給圧力	0.5~0.7MPa
	消費流量	平均250 ℓ /min(AMR) ※但しエアーブローを除く
N ₂ ガス	供給圧力	0.5~0.7MPa
	消費流量	平均100 ℓ /min
切削水	供給圧力	0.4~0.5MPa
	最大流量	12 ℓ /min
洗浄水	供給圧力	0.4~0.5MPa
	最大流量	4 ℓ /min
スピンドル冷却水	供給圧力	0.2~0.5MPa
	消費流量	3 ℓ /min(市水可)
装置寸法		1,650 ^W ×1,420 ^D ×1,800 ^H mm ※但し突起物含まず
装置重量		1,800kg

主なオプション

- 内蔵UV照射装置
- 昇圧ポンプ
- 強制排気ファン
- 恒温水装置
- 静電気除去装置
- Z軸スケール
- 顕微鏡照明の光源色変更
- ブレード3インチ対応
- 切削部エアー加速洗浄ユニット
- メロディアラーム
- バーコード自動品種切替え
- ドレス用カセット
- フレームバキュームクランプ
- 生産管理サポートシステム
- GEM通信機能
- 稼働管理システム
- マルチ電源対応トランス
- 比抵抗、温度モニター

株式会社東京精密 (お問合せはお近くの取扱店まで)

■半導体製造機器取扱営業所

東京営業所	(042)631-5211	(042)631-5234
大阪営業所	(06)6821-0361	(06)6821-0210
九州営業所	(097)538-1985	(097)538-1989

■半導体製造機器サービスステーション

仙台出張所	(022)224-0177	(022)224-7083
山形出張所	(023)631-5125	(023)625-4129
鶴岡出張所	(0235)29-8020	(0235)29-8022
会津出張所	(0242)38-2359	(0242)29-1251
東京CE課	(042)642-0358	(042)642-0367
東京CE課/土浦出張所	(0298)34-8550	(0298)31-6808
四日市出張所	(0593)61-6610	(0593)66-2210

北陸出張所	(076)422-6756	(076)422-6757
大阪CE課	(06)6821-0225	(06)6821-0210
東広島出張所	(082)493-5618	(082)493-5619
熊本出張所	(096)387-5188	(096)386-1592
九州CE課	(097)534-3291	(097)538-1989
国分出張所	(0995)43-2510	(0995)43-2586
八王子パーツセンター	(042)642-0381	(042)642-0397

■東精エンジニアリング

土浦事業所CEグループ	(029)830-1882	(029)830-1881
土浦事業所パーツセンター	(029)830-1882	(029)830-1881
名古屋事業所	(0561)32-3605	(0561)34-2744